

名古屋大学 未来材料・システム研究所
附属未来エレクトロニクス集積研究センター未来デバイス部 研究員の公募

1. 公募人数：研究員（任期付正職員） 1名
2. 所 属：名古屋大学 未来材料・システム研究所
附属未来エレクトロニクス集積研究センター未来デバイス部
3. 勤 務 地：名古屋大学 名古屋市千種区不老町
4. 勤務条件：1) 給 与：年俸制（本人の経験等を勘案して、名古屋大学年俸制適用職員給与規程に基づき決定します。）
2) 保 険：文部科学省共済組合（健康保険, 厚生年金）, 雇用保険, 労災保険
5. 職務内容：本グループでは、主に窒化物半導体, 炭化珪素やカーボンナノチューブなど新材料の創製およびデバイス作製の研究を行っています。
本公募においては、以下の業務に携わる研究員を募集します。
 - 1) 窒化物半導体及びCNTを用いたデバイスプロセスに関する研究開発
 - 2) デバイスの表界面制御に関する研究開発
6. 応募資格：博士号取得者、または、着任予定時までに取得見込みであること。
健康で本研究に意欲を持って取り組んでいただける方。
半導体デバイス、半導体界面・表面研究等の経験を有するものが望ましい。
着任予定時に主たる職、もしくは大学院生、研究生等の身分を有していないこと。
7. 雇用期間：平成29年12月以降のできるだけ早い日～平成30年3月31日
雇用は年度単位。
（最長平成33年3月31日まで更新する可能性あり）
最終雇用年齢は65歳に達した年の3月31日まで。
8. 提出書類：以下の1)～4)の書類を下記提出先にE-mailで送付してください。郵送の場合は封筒の表に「研究員応募書類在中」の旨を朱書し、書類を送付ください。
 - 1) 履歴書（写真入り）
 - 2) 業績目録（著書, 執筆論文, 学会発表等, 特許等）
 - 3) 主要な論文あるいは特許の別刷り、またはそのコピー（3編以内）
 - 4) これまでの主な研究内容の要約と着任後の抱負（A4で1枚程度）

9. 選考方法：書類選考および面接審査

10. 応募締切：平成29年9月22日(金)17時必着

11. 応募書類の提出先・問い合わせ先：

〒464-8603 名古屋市千種区不老町 工学部気付

名古屋大学未来材料・システム研究所

未来エレクトロニクス集積研究センター 担当：近藤

TEL：052-789-3157 e-mail：mkondo@imass.nagoya-u.ac.jp

12. その他：1) 提出書類は原則として返却いたしません。いただいた情報は採用審査のために使用し、これ以外の目的には使用致しません。
- 2) 面接のための交通費は自己負担とします。
- 3) キャンパスマップ： http://www.nagoya-u.ac.jp/upload_images/campus_map_jp.pdf
(案内図：C3①)